

# 高性能RTP装置と画期的なインパルス発生器のご紹介

ネクスファイ・テクノロジー株式会社  
インパルス発生器



モータ巻線などの絶縁試験、ナノプラズマ高繰り返し放電を用いた表面改質、液中プラズマを用いた有害物質の分解などに最適！



(約350x400x420mm)

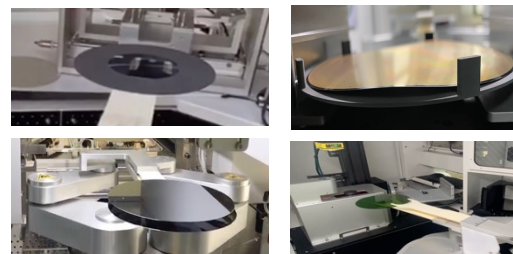
- ・ 最大出力電圧：5kV ※2
  - ・ 最大出力電流：1A
  - ・ パルス連続繰り返し数：  
<math><1\text{Mpps}</math>
  - ・ パルス立上り時間：  
**<math><50\text{ns}@5\text{kV}!!</math>**
- ※2 10kV出力までラインアップ予定

100/200VACから最大10kVのインパルスが発生可能。  
立上がり速度は50ns以下と超高速。

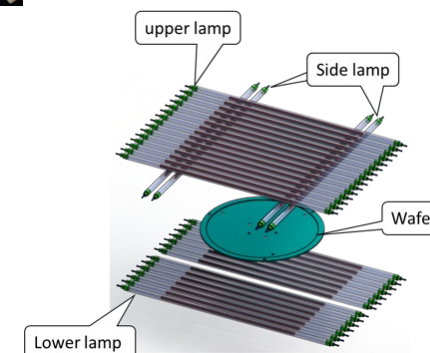
台湾Premtek社 RTP装置  
RTP-1200Aシリーズ



Premtek社のRTP装置は世界で500台以上の納入実績があり、その多くが化合物プロセスで使用されています。



サセプタを使用してのチャンバー内のプロセスを実施するためSiC/Silicon/Sapphire/GaAs/InPなど多くの化合物ウエハの処理が可能です。また、化合物ウエハの反りが原因での温度測定不良を防ぐために、サセプタ上にTPを配置しています。



上面ランプ、下面ランプ、再度ランプを複数のゾーンに分配し、各々のゾーンを個別にPIDコントロールすることにより高い面率均一性を実現しています。